PAT-NO:

JP404023373A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 04023373 A

TITLE:

LASER CONTROL DEVICE

PUBN-DATE:

January 27, 1992

## INVENTOR-INFORMATION:

NAME

**COUNTRY** 

IEHISA, NOBUAKI

## **ASSIGNEE-INFORMATION:**

NAME

**COUNTRY** 

FANUC LTD N/A

APPL-NO:

JP02124571

**APPL-DATE:** May 15, 1990

INT-CL (IPC): H01S003/00, B23K026/00, H01S003/094, H01S003/10

US-CL-CURRENT: 372/9

# ABSTRACT:

PURPOSE: To enable an operator to grasp correctly a remaining workable time and to execute reliably a cleaning of optical components and the like by a method wherein a characteristic curve is found from a laser oscillation efficiency and the workable time is calculated and is displayed.

CONSTITUTION: Laser output measured by a power sensor 24 is converted into a digital value by an AD converter 25 and is stored in a memory 10, while an output voltage and highfrequency current of a power supply for excitation use are also read in the memory 10. This laser output, the output voltage and the high-frequency current are stored in each time of rise of a laser. An efficiency calculating means 31 finds excitation input from this output voltage and the high-frequency current and finds a laser oscillation efficiency from this excitation input and the laser output. A characteristic curve generating means 32 generates a characteristic curve from this laser oscillation efficiency. A working time calculating means 33 calculates a workable time of up to reach a low limit of laser oscillation efficiency from the characteristic curve and displays the workable time on a display 18.

COPYRIGHT: (C)1992, JPO& Japio

# 19日本国特許庁(JP)

①特許出願公閉

# ◎公開特許公報(A) 平4-23373

④公開 平成4年(1992)1月27日 識別記号 庁内整理番号 Sint. Cl. 5 7630-4M 7920-4E 3/00 G H 01 S B 23 K 26/00 M H OI S 3/094 Z 7630-4M 3/10 3/094 7630-4M H 01 S (全8頁) 審査請求 未請求 請求項の数 9

②特 願 平2-124571

図出 願 平2(1990)5月15日

⑩発 明 者 家 久 信 明 山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場3580番地 フアナック

株式会社レーザ研究所内

⑪出 願 人 フアナツク株式会社 山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場3580番地

個代 理 人 弁理士 服部 毅巖

#### 明知音

# 1. 発明の名称

レーザ制御装置

# 2. 特許請求の範囲

(1) 高周波電圧による励起入力によって励起されるレーザ発振器を制御するレーザ制御装置において

前記レーザ発援器のレーザ出力を測定するレー ザ出力測定手段と、

.前記励起入力と、レーザ出力からレーザ発援効果を計算する効率計算手段と、

複数の前記レーザ発振効率を基に、レーザ発振 効率の効率特性曲線を生成する特性曲線生成手段 と、

前記効率特性曲線から、下限レーザ発展効率ま での稼働可能時間を計算する稼働時間計算手段と、 前記稼働可能時間を表示する表示装置と、 を有することを特徴とするレーザ制御装置。

- (2) 前記励起入力は、放電励起型ガスレーザの 場合には放電電流と印加電圧との頃による電力に よって決定することを特徴とする請求項1記載の レーザ制御装置。
- (3) 前記励起入力は、光励起型固体レーザの場合には励起光を発生させる励起ランプの励起入力、あるいはレーザダイオードの励起入力とすることを特徴とする請求項1記載のレーザ制御装置。
- (4) 前記レーザ出力側定手段はレーザ発振器を 構成するり下鏡から透過して出射されるレーザ光 を側定するように構成したことを特徴とする請求 項1記載のレーザ制御装置。
- (5) 前記核樹可能時間とともに、あるいは単独で、一回当たりの稼働時間から、使用可能な起動回数を計算して、前記表示装置に表示することを特徴とする請求項1記載のレーザ制御装置。
- (6) 前記効率特性曲線が回帰曲線であることを 特徴とする請求項1記載のレーザ制御装置。
- (7) 前記回帰曲線が指数関数曲線であることを 特徴とする請求項 6 記載のレーザ制御装置。

(8) 前記回帰曲線を生成するために使用するデータを前記複数個のデータから任意に抽出、選択できるように、前記特性曲線生成手段を構成したことを特徴とする請求項6記載のレーザ制御装置。(9) 前記稼働可能時間を越えたときに、警告表示を前記表示画面に表示し、同時に警告音を発する警告音発生装置を備えたことを特徴とする請求項1記載のレーザ制御装置。

## 3. 発明の詳細な説明

## 〔産業上の利用分野〕

本発明はレーザ発援器を制御するレーザ制御装置に関し、特にレーザ発振器の保守情報を表示するレーザ制御装置に関する。

## 〔従来の技術〕

CO,ガスレーザ等のガスレーザ発援器は高効 軍で高出力が得られ、ピーム特性も良いので、数 質制御装置と結合されたNCレーザ装置として金 属加工等に広く使用されるようになった。このよ

が剝離する。

このような原因により、レーザ発展効率は稼働時間とともに低下する。第6図はレーザのな。第6図の版社レーザ発援効率の関係を示す図である。第6図の版社レーザ発援効率の関係を励時間トであり、が発展のはレーザ発援のなった。こので、レーザ発展のはガールを発展のである。こので、カー・271081号がある。この警告の清掃をするとが行われている。この警告の清掃をすることが行われている。この警告の清掃をすることが行われている。この警告の清掃をするとが行われている。この警告の清掃をする。この管告の清掃をするとが発生した後、速やかに実施しなければならない。

## [発明が解決しようとする課題]

しかし、オペレータはレーザ発振装置を起動してみて、始めて警告を知ることとなる。通常、オペレータはレーザ発振装置を使用してレーザ加工の予定を長期的に立てているため、突然発生する

うなガスレーザ発振器においては、発援効率を向上させるために、レーザ発振を行って高温になったレーザガスを充分再冷却する必要がある。このため、レーザガスを絶えずルーツブロワ等の送風機で冷却器を通して装置内を循環させている。

しかし、この送風機によりレーザガスが高速で 循環している送風系内部には、送風機の軸受け部 に使用されている潤滑剤、例えばグリースまたは オイルが封入されており、この潤滑剤が送風系に 微量であるが混入する。また、レーザ発振器を製 造する場合においても偶発的に送風系内部にSi (シリコン)、Fe(鉄)を主成分とする塵埃等 が混入する。

混入した潤滑剤、塵埃等は送風系を経由してレーザ共振器を構成する光学部品の表面に付着し、 光学部品の反射率または透過率を低下させる。

また、レーザ共振器に使用されている光学部品、 特に出力鏡を構成する誘電体コーティングは光耐 力が弱いために、これらの潤滑剤、医埃等が付着 しない場合においてもレーザ発振とともに誘電体

警告に対して、直ちに光学部品の滑揚、交換を実 施することが不可能な場合が多い。

この結果、ともすれば光学部品の清掃や交換がなおざりになり、レーザ発振器は指令出力と実際に出射されるレーザ出力が一致するように入力電力を増加させ、過大な負担がレーザ励起用電源にかかる。さらに、このような状況が長く続くと、レーザ励起電源や放電管等の破壊に至る場合も生じていた。

これらの対策として注入電力をクランプする機能を追加することも考えられるが、レーザ励起電源や放電管が破壊されるのが防止できるが、光学部品の清掃は積極的に実施されないまま、光学部品の清掃で初期性能を回復するものが、交換をしなければならない程度まで劣化してしまうような結果となる。

また、このような警告が発生する前に光学部品の清掃を行う為に注意深くレーザ発振器のレーザ発振効率を起動毎に確認し、下限レーザ発振効率 n 2 より高い、レーザ発振効率 n 1 を目安にクリ

ーニングを行うことも可能である。

第7回はレーザ発展効率の変化が異なる2つの特性曲線を示す図である。各軸の意味は第6回と同じである。効率特性曲線Cでは効率の1から稼働時間haで下限レーザ発援効率で2に達する。一方、効率特性曲線Bでは、発振効率の1から下限レーザ発振効率の2に到達するまでは長時間となる。従って、特性曲線Bの場合は光学部品を清掃しなくも良いのに清掃をすることになる。

本発明はこのような点に鑑みてなされたものであり、レーザ発版器の起動時にレーザ発版数率を計算し、これらのデータから下限レーザ発版効率 に到達する時間を推定して、表示するレーザ制御 装置を提供することを目的とする。

## [課題を解決するための手段]

本発明では上記課題を解決するために、

高周波電圧による励起入力によって励起される レーザ発展器を制卸するレーザ制御装置において、 前記レーザ発振器のレーザ出力を測定するレーザ

る。これによって、事前に光学部品の清掃を実施 する計画を立てることが出来るので、光学部品の メインテナンスが確実に、また速やかに行われる。

# (実施例)

以下、本発明の一実施例を図面に基づいて説明 する。

出力測定手段と、前記励起入力と、レーザ出力からレーザ発援効率を計算する効率計算手段と、 複数の前記レーザ発援効果を基に、レーザ発援効率の効率特性曲線を生成する特性曲線生成手段と、前記効率特性曲線から、下限レーザ発援効率までの移働可能時間を計算する移働時間計算手段と、前記稼働可能時間を表示する表示装置と、を有することを特徴とするレーザ制御装置が、提供される。

#### (作用)

効率計算手段は、レーザ励起入力とレーザ出力からレーザ発援効率を計算する。このレーザ発援効率を計算する。このレーザ発援効率をレーザ発援器の起動時毎に求め、これらのデータから効率特性曲線を求める。徐働時間計算手段は効率特性曲線から、下限レーザ発援効率までの稼働可能時間を計算する。この稼働可能時間は表示装置に表示される。

従って、オペレータはレーザ発振器内部の光学 部品の清掃時期を正確に予知することが可能にな

して、プロセッサ1によって読み取れるように構成されている。この出力電圧及び高周波電流は後述の励起入力の計算に使用される。

放電管4の内部にはレーザガス19が競貨しており、励起用電源3から高周波電圧が印加されると放電を生じてレーザガス19が励起される。

リア競 5 は反射率 9 9 . 5 %のゲルマニウム (Ge) 製の筬、出力鏡 6 は反射率 6 5 %のジンクセレン (2 n Se) 製の鏡であり、これらはファブリベロー型共振器を構成し、励起されたレーザカス分子から放出される 1 0 . 6 μmの光を増幅して一部を出力鏡 6 からレーザ光 7 として外部に出力する。

出力されたレーザ光?は、後述するシャッタ 2 3 a が開いている時には、ペンダミラー 8 で方向を変え、集光レンズ 9 によって 0.2 mm以下のスポットに集光されてワーク 1 7 の表面に照射される

メモリ10は加工プログラム、各種のパラメー タ符を格納する不揮発性メモリであり、パッテリ バックアップされたCMOSが使用される。なお、この他にシステムプログラムを格納するROM、一時的にデータを格納するRAMがあるが、本図ではこれらを省略してある。

位置制卸回路11はプロセッサ1の指令によってサーボアンプ12を介してサーボモータ13を回転制卸し、ボールスクリュー14及びナット15によってテーブル16の移動を制卸し、ワーク17の位置を制卸する。図では1軸のみを表示してあるが、実際には複数の制卸軸がある。表示装置18にはCRT或いは液晶表示装置等が使用される。

送風機20にはルーツブロワが使用され、レーザガス19を冷却器21a及び21bを通して循 頃する。冷却器21aはレーザ発振を行って高温 となったレーザガス19を冷却するための冷却器 であり、冷却器21bは送風器20による圧縮熱 を除去するための冷却器である。

シャッタ制卸回路 2 2 はプロセッサ 1 の指令に 基づいてシャッタ 2 3 a を開閉する。シャック 2 を測定する。A/D変換器 2 5 はパワーセンサ 2 4 の出力をディジタル値に変換してプロセッサ 1 に入力する。
第1 図は本発明の一実施例のレーザ制御装置の 稼働可能時間を求める機能を達成するためのプロック 図である。パワーセンサ 2 4 によって側定されたレーザ出力は A D変換器 2 5 でディジタル値に変換されて、メモリ 1 0 に格納される。一方、

励起用電源3の出力電圧及び高周波電流もメモリ

10に読み込まれる。このレーザ出力、出力電圧、

3 aは表面に金メッキが脆された銅板またはアル

ミ板で構成されており、閉時には出力鏡 6 から出

力されたレーザ光?を反射してピームアブソーバ

23 bに吸収させる。シャッタ23aを開くとレ

パワーセンサ24は熱電あるいは光電変換案子

等で構成され、リア院 5 から一部透過して出力さ

れたレーザ光を入力してレーザ光?の出力パワー

ーザ光7がワーク17に照射される。

高周披電流はレーザの立ち上がり時毎に記憶されていく。効率計算手段31はこの出力電圧及び高

周波電流から励起入力を求め、この励起入力とレーザ出力からレーザ発援効率を求める。特性曲線生成手段32はこのレーザ発援効率から特性曲線を生成する。稼働時間計算手段33は特性曲線から下限レーザ発援効率に到達するまでの稼働可能時間を計算して、表示装置18に表示する。

第3図は本発明の処理のフローチャートである。 図において、Sに続く数値はステップ番号を示す。 〔Si〕効率計算手段31はメモリ10のレーザ 出力を読み取り、励起用電源3の出力電圧、高周 彼電流から励起入力を求める。この励起入力とレ ーザ出力からレーザ発援効率を求める。

【S2】特性曲線生成手段32はこれらのレーザ 発援効率から、特性曲線を生成する。特性曲線に ついては後述する。

(S3) 核働時間計算手段33は、この特性曲線から、下限レーザ発援効率 n & に到達するまでの稼働可能時間を計算する。

(S4) この稼働可能時間を表示装置 18 に表示する。なお、効率計算手段 31、特性曲線生成手

段32、核働時間計算手段33はソフトウェアで、 構成される。

なお、稼働可能時間を越えて、レーザ装置が運転されているときは、その旨の警告を表示装置1 8に表示するとともに、オペレータへの警告音を 発生する警告音発生装置を設けることもできる。

第4図は特性曲線の例を示す図である。第4図では機軸はレーザ発援器の稼働時間 h、 凝軸はレーザ発援効率のである。特性曲線 A は稼働時間とともに、レーザ発援効率が低下していく様子を表している。今、点Pbの位置にあるものとすると、稼働可能時間 h r 経過後に下限レーザ発援効率のℓに到達するものと推定できる。特性曲線 A は一般に、

 $A = K \cdot e \times p \left(-\alpha t\right)$ 

で表すことができる。ここで、Kは定数、αは減 変定数である。

第5 図は第4 図のB部の詳細を示す図である。 ここでは、点Pbでのレーザ発援効率をNとし、 一回前のレーザ発援効率を(N-1) とし、8 回

## 特閒平4-23373(5)

前のレーザ発援効率を(N-8)で表している。 これらの点を回帰分析により、巨層曲線として、  $A=K-exp(-\alpha t)$ 

を満足するようにΚ、αを求める。

また、これらのレーザ発振効率のデータは連続 に取らずに、1個おき、あるいは2個おき毎にと るように、複数個のデータから任意に抽出、選択 できるようにすることもできる。

上記の説明では、下限レーザ発振効率の 2 に到達するまでの稼働可能時間を表示装置に表示することで説明したが、一般に一回当たりの稼働時間は一定である場合が多いので、一回当たりの稼働時間から、使用可能な起動回数を計算して、前記表示装置に表示するようにすることもできる。

上記の説明では、CO。ガスレーザ装置のレーザ発援効率を例に説明したが、光励起型固体レーザの場合には励起光を発生させる励起入力と、励起ランプの出力との効率に対して、同様に適用することができる。すなわち、上記のように特性曲線を求め、励起ランプの寿命を表示することがで

きる。また、励起用にレーザダイオードを使用する場合も、レーザダイオードを一定時間毎に交換する必要があるので、同様に、レーザダイオードに注入される注入電力と、レーザ出力から発援効率を求め、稼働可能時間を計算して、表示装置に表示することができる。

## [発明の効果]

以上説明したように本発明では、レーザ発振効 率から、特性曲線を求め、稼働可能時間を計算し で表示するように構成したので、オペレータは残 りの稼働可能時間を正確に把握することができ、 光学部品の清掃等を確実に実施することができる。

また、的確にメインテナンスができるので、光 学部品の劣化、破損を防止できる。

さらに、本発明は固体レーザの励起ランプ、レ ーザダイオード等の交換等にも適用でき、同様の 効果を得ることができる。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例のレーザ制御装置の 稼働可能時間を求める機能を達成するためのブロック図。

第2図は本発明の一実施例のレーザ制御装置の ハードウェアの構成を示したブロック図、

第3図は本発明の処理のフローチャート、

第5図は第4図のB部の詳細を示す図、

第4図は特性曲線の例を示す図、

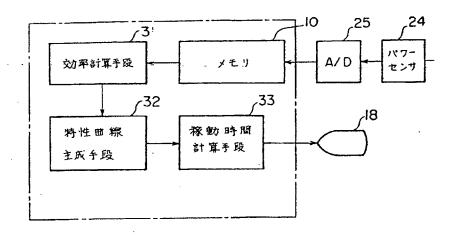
第6図はレーザの稼働時間とレーザ発援効率の 関係を示す図、

第7 図はレーザ発援効率の変化の異なる2つの 特性曲線を示す図である。

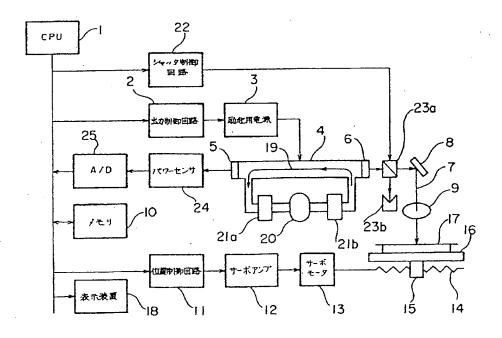
- 1 ……...プロセッサ
- 4 ……放電管
- 10 ……メモリ
- 1 8 ……表示装置
- 2 4 ……バワーセンサ
- 3 1 ……………………効率計算手段

3 2 特性曲線生成手段 3 3 特性曲線生成手段

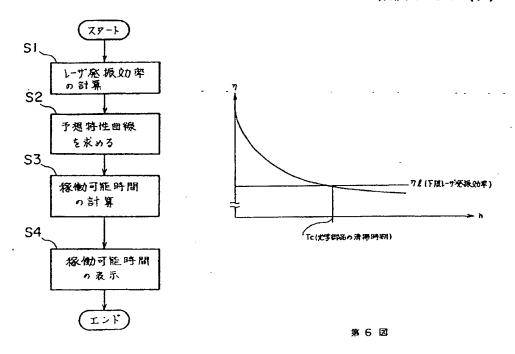
特許出願人 ファナック株式会社 代理人 弁理士 服邸設験



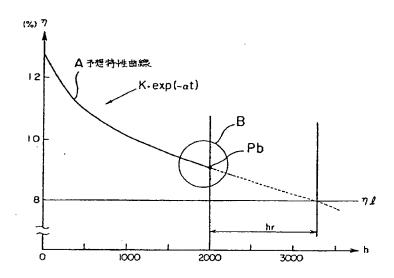
第 | 図

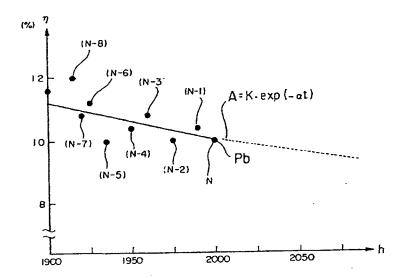


第2図

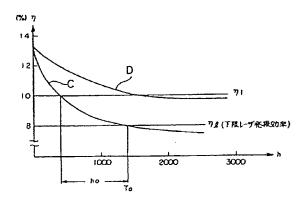


第3図





第 5 図



第7 図

PAT-NO:

v

JP404023373A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 04023373 A

TITLE:

LASER CONTROL DEVICE

PUBN-DATE:

January 27, 1992

# INVENTOR-INFORMATION:

NAME

**COUNTRY** 

IEHISA, NOBUAKI

# **ASSIGNEE-INFORMATION:**

NAME

**COUNTRY** 

FANUC LTD N/A

APPL-NO:

JP02124571

**APPL-DATE:** May 15, 1990

INT-CL (IPC): H01S003/00, B23K026/00, H01S003/094, H01S003/10

US-CL-CURRENT: 372/9

# ABSTRACT:

PURPOSE: To enable an operator to grasp correctly a remaining workable time and to execute reliably a cleaning of optical components and the like by a method wherein a oscillation efficiency and the workable time is characteristic curve is found from a laser calculated and is displayed.

sensor 24 is converted into a digital CONSTITUTION: Laser output measured by a power 10, while an output voltage and highvalue by an AD converter 25 and is stored in a memory frequency current of a power supply for excitation use are also read in the memory 10. This laser output, the output voltage and the high-frequency current are stored in each time of rise of a laser . An efficiency calculating means 31 finds excitation input from this output voltage and the high-frequency current and finds a laser oscillation efficiency from this output. A characteristic curve generating means 32 generates a excitation input and the laser characteristic curve from this laser oscillation efficiency. A working time calculating means 33 calculates a workable time of up to reach a low limit of laser oscillation efficiency from the characteristic curve and displays the workable time on a display 18.

COPYRIGHT: (C)1992, JPO& Japio

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-23373

©lnt. Cl. 5 H 01 S 3/00 B 23 K 26/00 H 01 S 3/094 3/10 識別記号 庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)1月27日

G 7630-4M M 7920-4E

Z 7630-4M

7630-4M H 01 S 3/094

S

審査請求 未請求 請求項の数 9 (全8頁)

69発明の名称

レーザ制御装置

②特 願 平2-124571

@出 願 平2(1990)5月15日

@発明者 家久

山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場3580番地 フアナック

株式会社レーザ研究所内

勿出 顧 人 フ

フアナツク株式会社

山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場3580番地

個代 理 人 弁理士 服部 毅姦

## 明細書

# 1. 発明の名称

レーザ制御装置

## 2. 特許請求の範囲

(1) 高周波電圧による励起入力によって励起されるレーザ発振器を制御するレーザ制御装置において、

前記レーザ発振器のレーザ出力を測定するレー ザ出力測定手段と、

前記励起入力と、レーザ出力からレーザ発援効 軍を計算する効率計算手段と、

複数の前記レーザ発振効率を基に、レーザ発振 効率の効率特性曲線を生成する特性曲線生成手段 と、

前記効率特性曲線から、下限レーザ発振効率ま での稼働可能時間を計算する稼働時間計算手段と、 前記稼働可能時間を表示する表示装置と、

を有することを特徴とするレーザ制御装置。

- (2) 前記励起入力は、放電励起型ガスレーザの 場合には放電電流と印加電圧との機による電力に よって決定することを特徴とする請求項1記載の レーザ制御装置。
- (3) 前記励起入力は、光励起型固体レーザの場合には励起光を発生させる励起ランプの励起入力、あるいはレーザダイオードの励起入力とすることを特徴とする請求項!記載のレーザ制御装置。
- (4) 前記レーザ出力側定手段はレーザ発振器を 構成するリア線から透過して出射されるレーザ光 を測定するように構成したことを特徴とする請求 項1記載のレーザ制御装置。
- (5) 前記稼働可能時間とともに、あるいは単独で、一回当たりの稼働時間から、使用可能な起助回数を計算して、前記表示装置に表示することを特徴とする請求項1記載のレーザ制御装置。
- (6) 前記効率特性曲線が回帰曲線であることを 特徴とする請求項1記載のレーザ制御装置。
- (7) 前記回帰曲線が指数関数曲線であることを 特徴とする請求項 6 記載のレーザ制御装置。

(8) 前記回帰曲線を生成するために使用するデータを前記複数個のデータから任意に抽出、選択できるように、前記特性曲線生成手段を構成したことを特徴とする請求項 6 記載のレーザ制御装置。(9) 前記稼働可能時間を越えたときに、警告表示を前記表示画面に表示し、同時に警告音を発する警告音発生装置を備えたことを特徴とする請求項1記載のレーザ制御装置。

# 3. 発明の詳細な説明

## 〔産業上の利用分野〕

本発明はレーザ発振器を制御するレーザ制御装 置に関し、特にレーザ発振器の保守情報を表示す るレーザ制御装置に関する。

# 〔従来の技術〕

CO,ガスレーザ等のガスレーザ発展器は高効 率で高出力が得られ、ピーム特性も良いので、数 値制砂装置と結合されたNCレーザ装置として金 属加工等に広く使用されるようになった。このよ

#### が剝離する。

このような原因により、レーザ発援効率は稼働時間とともに低下する。第6図はレーザの稼働時間とレーザ発援効率の関係を示す図である。第6図の機能はレーザ発振効率のである。ここで、レーザ発振効率である。ここで、レーザ発振力に対する。ここで、カローザ発展のである。この事態になずで表現の活動をすべる。この事態によりによりに変われている。この事態になりによりに変われている。この事態になりによりに変われている。この事態になりに変われている。この事態になりに変われている。この事態になりに変われている。この事態になりに変われている。この事態になりに変われている。この事態になりに変われている。この事態になりに変われている。この事態になりに変われている。この事態になりに変われている。この事態になりに変われている。この事態になりに変われている。

# [発明が解決しようとする課題]

しかし、オペレータはレーザ発振装置を起動してみて、始めて警告を知ることとなる。 通常、オペレータはレーザ発振装置を使用してレーザ加工の予定を長期的に立てているため、突然発生する

うなガスレーザ発振器においては、発振効率を向上させるために、レーザ発振を行って高温になったレーザガスを充分再冷却する必要がある。このため、レーザガスを絶えずルーツブロワ等の送風機で冷却器を通して装置内を循環させている。

しかし、この送風機によりレーザガスが高速で 循環している送風系内部には、送風機の軸受け部 に使用されている潤滑剤、例えばグリースまたは オイルが封入されており、この潤滑剤が送風系に 数量であるが混入する。また、レーザ発振器を製 造する場合においても偶発的に送風系内部にS; (シリコン)、Fe(鉄)を主成分とする废埃等 が混入する。

混入した潤滑剤、塵埃等は送風系を経由してレーザ共振器を構成する光学部品の表面に付着し、 光学部品の反射率または透過率を低下させる。

また、レーザ共振器に使用されている光学部品、 特に出力競を構成する誘電体コーティングは光耐 力が弱いために、これらの潤滑剤、塵埃等が付着 しない場合においてもレーザ発振とともに誘電体

警告に対して、直ちに光学部品の清掃、交換を実 施することが不可能な場合が多い。

この結果、ともすれば光学部品の清掃や交換がなおざりになり、レーザ発振器は指令出力と実際に出射されるレーザ出力が一致するように入力電力を増加させ、過大な負担がレーザ励起用電源にかかる。さらに、このような状況が長く続くと、レーザ励起電源や放電管等の破壊に至る場合も生じていた。

これらの対策として注入電力をクランプする機能を追加することも考えられるが、レーザ励起電源や放電管が破壊されるのが防止できるが、光学 部品の清掃は積極的に実施されないまま、光学部品の清掃で初期性能を回復するものが、交換をしなければならない程度まで劣化してしまうような結果となる。

また、このような警告が発生する前に光学部品の清掃を行う為に注意深くレーザ発振器のレーザ発振効率を起動毎に確認し、下限レーザ発振効率 ヵ & より高い、レーザ発振効率 ヵ 1 を目安にクリ ーニングを行うことも可能である。

第7 図はレーザ発振効率の変化か異なる 2 つの特性曲線を示す図である。各軸の意味は第6 図と同じである。効率特性曲線では効率 1 1 から移動時間 h a で下限レーザ発振効率 1 2 に達する。一方、効率特性曲線 B では、発援効率 1 1 から下限レーザ発振効率 1 2 に到達するまでは長時間となる。従って、特性曲線 B の場合は光学部品を清掃しなくも良いのに清掃をすることになる。

本発明はこのような点に鑑みてなされたものであり、レーザ発振器の起動時にレーザ発振効率を計算し、これらのデータから下限レーザ発振効率に到達する時間を推定して、表示するレーザ制御装置を提供することを目的とする。

# [課題を解決するための手段]

本発明では上記課題を解決するために、

高周波電圧による励起入力によって励起される レーザ発振器を制御するレーザ制御装置において、 前記レーザ発振器のレーザ出力を測定するレーザ

る。これによって、事前に光学部品の清掃を実施 する計画を立てることが出来るので、光学部品の メインテナンスが確実に、また速やかに行われる。

## (実施例)

以下、本発明の一実施例を図面に基づいて説明する。

出力測定手段と、前記励起入力と、レーザ出力からレーザ発援効率を計算する効率計算手段と、、 数の前記レーザ発援効率を基に、レーザ発援効率 の効率特性曲線を生成する特性曲線生成手段と、 前記効率特性曲線から、下限レーザ発援効率まで の移傷可能時間を計算する稼働時間計算手段と、 前記稼傷可能時間を表示する表示装置と、を有す ることを特徴とするレーザ制御装置が、提供される。

## (作用)

効率計算手段は、レーザ励起入力とレーザ出力からレーザ発援効率を計算する。このレーザ発援 効率をレーザ発振器の起動時毎に求め、これらの データから効率特性曲線を求める。稼働時間計算 手段は効率特性曲線から、下限レーザ発振効率ま での稼働可能時間を計算する。この稼働可能時間 は表示装置に表示される。

従って、オペレータはレーザ発振器内部の光学 部品の清掃時期を正確に予知することが可能にな

して、プロセッサ 1 によって読み取れるように構成されている。この出力電圧及び高周波電流は後述の励起入力の計算に使用される。

放電管4の内部にはレーザガス19が循環しており、励起用電源3から高周波電圧が印加されると放電を生じてレーザガス19が励起される。

リア統 5 は反射率 9 9. 5 %のゲルマニウム (Ge) 製の鏡、出力鏡 6 は反射率 6 5 %のジンクセレン (ZnSe) 製の鏡であり、これらはファブリベロー型共振器を構成し、励起されたレーザガス分子から放出される 1 0. 6 μmの光を増幅して一部を出力鏡 6 からレーザ光 7 として外部に出力する。

出力されたレーザ光?は、後述するシャッタ?3aが開いている時には、ベンダミラー8で方向を変え、集光レンズ9によって0.2mm以下のスポットに集光されてワーク17の表面に照射される。

メモリ10は加工プログラム、各種のパラメー タ等を格納する不揮発性メモリであり、バッテリ バックアップされたCMOSが使用される。なお、この他にシステムプログラムを格納するROM、一時的にデータを格納するRAMがあるが、本図ではこれらを省略してある。

位置制御回路11はプロセッサ1の指令によってサーボアンプ12を介してサーボモータ13を回転制御し、ボールスクリュー14及びナット15によってテーブル16の移動を制御し、ワーク17の位置を制御する。図では1軸のみを表示してあるが、実際には複数の制御軸がある。表示装置18にはCRT或いは液晶表示装置等が使用される。

送風機20にはルーツブロワが使用され、レーザガス19を冷却器21a及び21bを通して循環する。冷却器21aはレーザ発振を行って高温となったレーザガス19を冷却するための冷却器であり、冷却器21bは送風器20による圧縮熱を除去するための冷却器である。

シャッタ制御回路 2 2 はプロセッサ 1 の指令に 基づいてシャッタ 2 3 a を開閉する。シャッタ 2

周波電流から励起入力を求め、この励起入力とレーザ出力からレーザ発振効率を求める。特性曲線生成手段32はこのレーザ発振効率から特性曲線を生成する。稼働時間計算手段33は特性曲線から下限レーザ発振効率に到達するまでの稼働可能時間を計算して、表示装置18に表示する。

第3図は本発明の処理のフローチャートである。 図において、Sに続く数値はステップ番号を示す。 (S1)効率計算手段31はメモリ10のレーザ 出力を読み取り、励起用電源3の出力電圧、高周 波電流から励起入力を求める。この励起入力とレ ーザ出力からレーザ発掘効率を求める。

(S2) 特性曲線生成手段32はこれらのレーザ発援効率から、特性曲線を生成する。特性曲線については後述する。

(S3) 核働時間計算手段33は、この特性曲線から、下限レーザ発援効率πℓに到達するまでの 稼働可能時間を計算する。

(S4) この稼働可能時間を表示装置!8に表示する。なお、効率計算手段31、特性曲線生成手

3 a は表面に金メッキが施された鋼板またはアルミ板で構成されており、閉時には出力鏡 6 から出力されたレーザ光 7 を反射してピームアブソーバ2 3 b に吸収させる。シャッタ 2 3 a を開くとレーザ光 7 がワーク 1 7 に照射される。

パワーセンサ 2 4 は熱電あるいは光電変換素子 等で構成され、リア競 5 から一部透過して出力されたレーザ光を入力してレーザ光 7 の出力パワーを測定する。 A / D変換器 2 5 はパワーセンサ 2 4 の出力をディジタル値に変換してプロセッサ 1 に入力する。

第1図は本発明の一実施例のレーザ制御装置の 稼働可能時間を求める機能を達成するためのブロック図である。パワーセンサ24によって側定されたレーザ出力はAD変換器25でディジタル値に変換されて、メモリ10に格納される。一方、 励起用電源3の出力電圧及び高周被電流もメモリ10に読み込まれる。このレーザ出力、出力電圧、 高周波電流はレーザの立ち上がり時毎に記憶されていく。効率計算手段31はこの出力電圧及び高

段32、稼働時間計算手段33はソフトウェアで 構成される。

なお、稼働可能時間を越えて、レーザ装置が運転されているときは、その旨の警告を表示装置 1 8 に表示するとともに、オペレータへの警告音を 発生する警告音発生装置を設けることもできる。

第4図は特性曲線の例を示す図である。第4図では横軸はレーザ発振器の稼働時間 h、 擬軸はレーザ発振効率 n である。特性曲線 A は稼働時間とともに、レーザ発振効率が低下していく 様子を表している。今、点P b の位置にあるものとすると、稼働可能時間 h r 経過後に下限レーザ発振効率 n ℓ に到達するものと推定できる。特性曲線 A は一般に、

 $A = K - e \times p (-\alpha t)$ 

で表すことができる。ここで、K は定数、αは減 登定数である。

第5図は第4図のB部の詳細を示す図である。 ここでは、点Pbでのレーザ発振効率をNとし、 一回前のレーザ発振効率を(N-1)とし、8回

## 特開平4-23373(5)

前のレーザ発援効率を(N-8)で表している。 これらの点を回帰分析により、回帰曲線として、  $A=K-e \times p \left(-\alpha t\right)$ 

を満足するようにΚ、αを求める。

また、これらのレーザ発援効率のデータは連続 に取らずに、1個おき、あるいは2個おき毎にと るように、複数個のデータから任意に抽出、選択 できるようにすることもできる。

上記の説明では、下限レーザ発援効率 n l に到達するまでの稼働可能時間を表示装置に表示することで説明したが、一般に一回当たりの稼働時間は一定である場合が多いので、一回当たりの稼働時間から、使用可能な起動回数を計算して、前記表示装置に表示するようにすることもできる。

上記の説明では、CO。ガスレーザ装置のレーザ発援効率を例に説明したが、光励起型固体レーザの場合には励起光を発生させる励起入力と、励起ランプの出力との効率に対して、同様に適用することができる。すなわち、上記のように特性曲線を求め、励起ランプの寿命を表示することがで

第1図は本発明の一実施例のレーザ制御装置の 稼働可能時間を求める機能を達成するためのブロック図、

第2図は本発明の一実施例のレーザ制御装置の ハードウェアの構成を示したブロック図、

第3図は本発明の処理のフローチャート、

第4 図は特性曲線の例を示す図、

第5図は第4図のB部の詳細を示す図、

第6図はレーザの稼働時間とレーザ発振効率の 関係を示す図、

第 ? 図はレーザ発援効率の変化の異なる 2 つの 特性曲線を示す図である。

1 ……ブロセッサ

3 ……励起用電源

4 ……放電管

10 ……メモリ

18 ……表示装置

2 4 ……パワーセンサ

3 1 ……効率計算手段

きる。また、励起用にレーザダイオードを使用する場合も、レーザダイオードを一定時間毎に交換する必要があるので、同様に、レーザダイオードに注入される注入電力と、レーザ出力から発振効 軍を求め、稼働可能時間を計算して、表示装置に表示することができる。

## [発明の効果]

以上説明したように本発明では、レーザ発振効 率から、特性曲線を求め、稼働可能時間を計算し て表示するように構成したので、オペレータは残 りの稼働可能時間を正確に把握することができ、 光学部品の清掃等を確実に実施することができる。

また、的確にメインテナンスができるので、光 学部品の劣化、破損を防止できる。

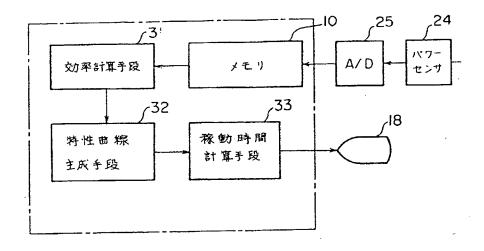
さらに、本発明は固体レーザの励起ランプ、レーーザダイオード等の交換等にも適用でき、同様の効果を得ることができる。

## 4. 図面の簡単な説明

3 2 ……特性曲線生成手段

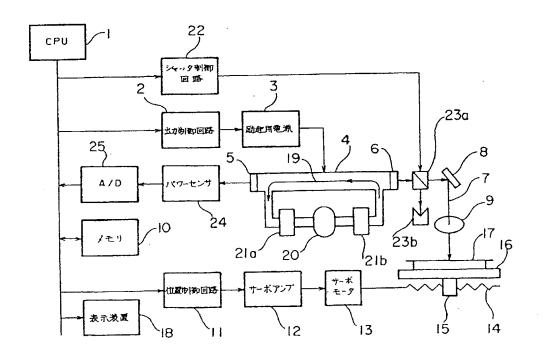
特許出願人 ファナック株式会社

代理人 弁理士 服部毅巖

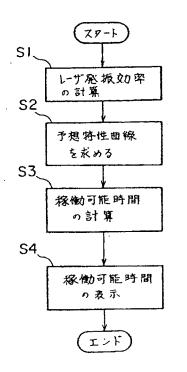


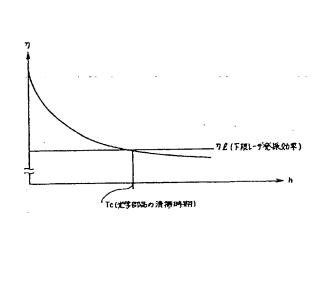
į

第 1 図



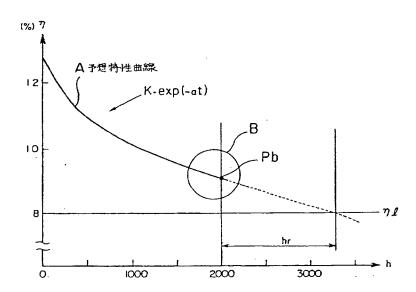
第 2 図



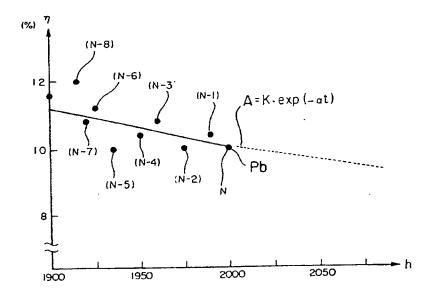


第6図

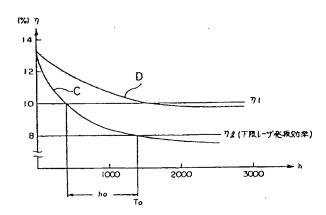
第3図



第 4 図



第 5 図



第7図